【出國經費結報】

(一)支出憑證點存單及國立中央大學國外出差旅費報告表。 國立中央大學支出憑證點存單 全 額 傳票編號 預算科目 經費來源(計畫名稱) 千百十萬千百十元 若有分攤,請依各經費來源分別填寫, 並檢附支出分攤表。若實際報支低於可-報支金額,請填寫實支 XXX 元並簽章。 國立中央大學 國外出差旅費報告表 姓 Z 王大明 職稱 專任人員 職等 字 虢 出差事由 中華民國 106 年 10 月 13 日起至 106 年 10 月 18 日止 共計 6 日附單據 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 總計 日期 臺灣→天津 天津→北京 北京→天津 天津→臺灣 起訖地點 天津 天津 工作記要 啟程 開會 開會 開會 開會 返程 24,500 24,500 飛機 交通費 若行政費未經補助單位 長途大眾 748 610 421 1,779 (計程車) (計程車) 陸運工具 5, 172 5, 172 6,513 5,172 4,722 1.687 28, 438 生 活 費 1,700 1,700 手續費 140 140保險費 辦公費 25, 678 25,678 行政費 禮品交際 核定,應事先簽准 2,592 2,592 及雜費 單據號數 60,530 5, 172 6,934 5, 172 4,722 2, 297 84,827 備 22 出差人 單 位 主 辦 會 主 管 計人員 計 畫 主辦人 機關首長或 事人員 授權代簽人 主持人

來且請 **※源:應與申請單い且出差日期、事由請依實際狀況填∵** · 山 填 寫 相 符經。

(之三十限額內報支)區生活費日支數額

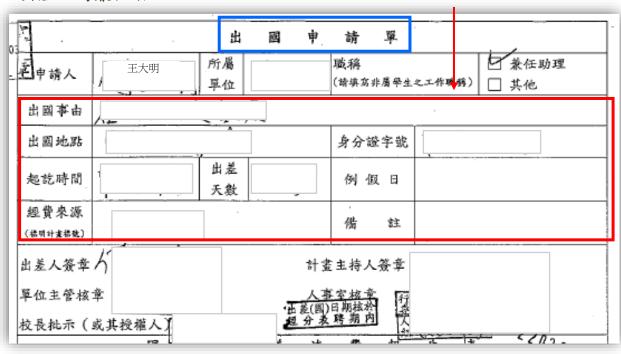
呈即 現使 全分 貌攤 亦 要列出 總

- (二)出國申請單。
 - ▲ 出差人為老師或行政人員或專任助理

		1	出國	申請-			
填單人姓名		單號	EXODUS-	201606-1387	申請時間		
申請人姓名	王大明	所屬單位				代理人姓名	無代理人
起始日期		結束日期 2	j	出國天數	地	黑	£
出國理由		開會		經費來源		*	
會議玄稱 20		2000000					

ዹ 出差人為兼任助理

出差日期、事由、經費來源:應與報告表相符。



(三)國立中央大學學生出國申請單。(出差人員為學生者始檢附)。

系級	學	Å	學號		\neg	
(i)/		dr.	7-200		_	_
姓名	馮ź					
起迄時間		•				
出國地點						
出國事由						
經費來源	名稱		20			-
(ex: XXX 老	V-					
師結餘款;			- W 24 - 35 - 35			_
XX 系捐贈收 入; XXX 國科	經費來源	所屬老師	或單位核	章		
會計畫)						
申請人簽章			導師(指導教授)簽章	
馮		6				
系所主管簽	章		校長招	b示(或授	權人)。	
返校銷案 簽證	該生於民	<u> </u>		到校	簽證銷案	
	學生所屬	条所簽証	农产品			

出差日期、事由、經費來源:應與報告表相符。

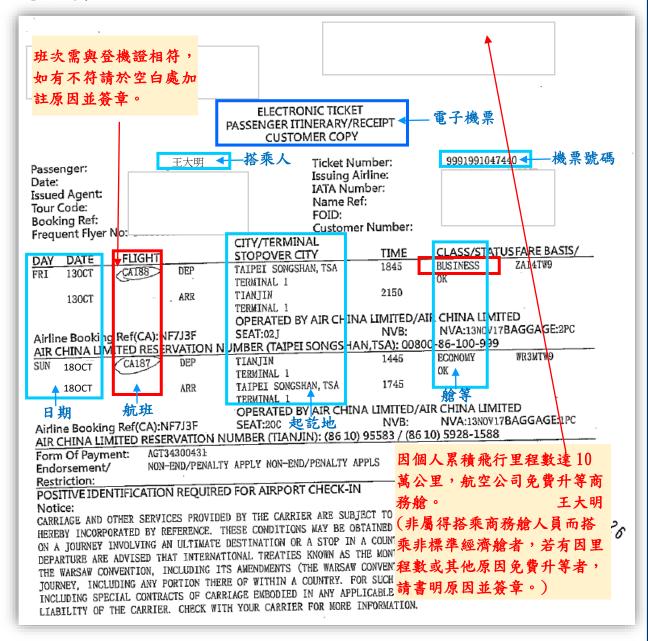
(三)國立中央大學科技部延攬客座科技人才及研究學者出國申請表。 (出差人為科技部延攬客座科技人才或研究學者應檢附)

	國立中央大	學科技部延攬客	· 座科技人才及	正本論單位自存 研究學者出國申請表
室	延攬單位		職 稿	
章	姓 名	王大明	到校日期	民國 105 年 04 月 20 日
Ť	聘 期	民國		
	申請出國日期	民國		
	申請出國事由	■出國開會 □執行研究計畫 □其他(請詳列):	□考察 □蒐集資料	聘期內已核 准出國日數
I	■ 與研究計畫2	有關 ,請同意 <u>不扣發</u> 教學	研究費。	
	□ 與研究計畫	無關,將優先以請假方式	戊處理,不足部分請同	意 <u>和發</u> 教學研究費。
П	□ 部分與研究	十畫 <u>有關</u> ,與研究計畫 <u>有</u>	關部分,請同意 <u>不扣</u>	登 教學研究費,其餘與研究計畫無
П		優先以請假方式處理,不		
П	(請假日期:)
П	□ 奉派長期駐夕	小,請同意 <u>不扣發</u> 教學研	究費。	
Н	□ 其他(請詳述	特殊情形):		
	申請人簽章		申請日期	
	聯絡人	計畫主持人簽	\$140 - 200 - 200 - 110 - 2089	
ŀ	分機:			5.
lŀ		人事室	出納組	0,00
Ī	李钟对许斯江静 岛	出人十四仙馆泰祖宗		决 行 ¹⁰⁵
2)18 15
3	,		F、考察或為執行和	开究計畫及蒐集資料》預書時雜台者,
١.	5. 1		钐經簽准者外,一	例假日),到職未滿1年者按實際在職 律核實扣發教學研究費。
			定,須檢附聘期內 審畫。	歷次出國校內同意出國申請表、本次
			牛並載明日期及行	程。 「行政院及所屬各級機關聘僱人員給
			49.4万列 间 6頁1段 KG 照	11 双阮及州屬各級機關聘僱人員給

【支出憑證】

(一)電子機票或機票票根或其他足資證明行程之文件。(擇一)

▲ 電子機票



- 》電子機票中之<u>搭乘人、出國日、返國日及起訖地</u>,需與<u>出差旅</u> 費報告表相符。
- ▶ 電子機票中之<u>搭乘人</u>、機票號碼、出國日、返國日、航班及起 訖地,需與登機證相符。
- ▶ 非屬得搭乘商務艙人員而搭乘非標準經濟艙者,若有因里程數或其他原因免費升等者,請書明原因並簽章。

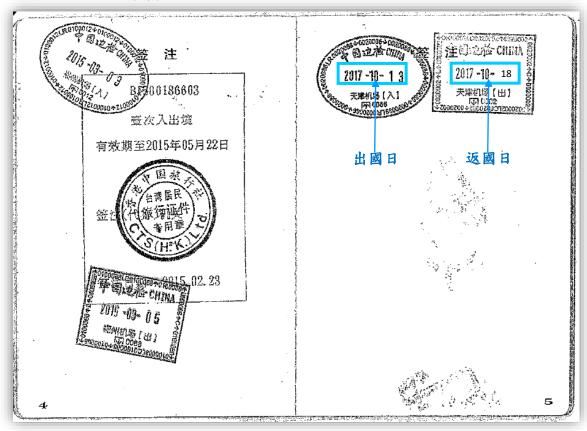
- (二)國際線航空機票購票證明單<u>或</u>旅行業代收轉付收據<u>或</u>其他足資證明支付票款之 文件(如信用卡帳單)。(擇一)
 - ዹ 旅行業代收轉付收據



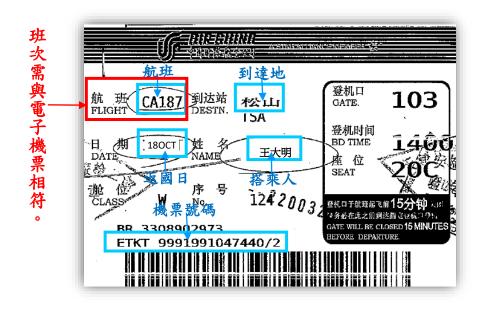
ዹ 國際線航空機票購票證明單



- (三)登機證存根(含電子登機證)<u>或</u>足資證明出國事實之護照影本<u>或</u>航空公司所開立 之搭機證明。(擇一)
 - ▲ 足資證明出國事實之護照影本



▲ 登機證存根



(四)因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書。(搭乘外國籍航空者檢附)

本人確因下列原因改搭外國籍航空班機(請於□內打勾): □出國、返國或轉機當日,本國籍航空公司班機客位已售滿。 ■出國、返國或轉機當日,無本國籍航空公司班機飛航。 □搭本國籍航空公司班機再轉機,其轉機等待時間超過四小時 □本國籍航空公司班機無法銜接轉運。 □其他特殊情況。 (說明:) 請依實際狀況,勾選上方選項, 若選其他特殊情況,則需說明。	H M M M / * /	搭乘外國籍	航空公司	月班機申請	青書
□出國、返國或轉機當日,本國籍航空公司班機客位已售滿。 ■出國、返國或轉機當日,無本國籍航空公司班機飛航。 □搭本國籍航空公司班機再轉機,其轉機等待時間超過四小時 □本國籍航空公司班機無法銜接轉運。 □其他特殊情況。 (說明:) 請依實際狀況,勾選上方選項,					
■出國、返國或轉機當日,無本國籍航空公司班機飛航。 □ 搭本國籍航空公司班機再轉機,其轉機等待時間超過四小時 □ 本國籍航空公司班機無法銜接轉運。 □ 其他特殊情況。 (說明:) 請依實際狀況,勾選上方選項,	本人確因下列原因	改搭外國籍航空	2班機(請	於□內打勾)	:
□ 搭本國籍航空公司班機再轉機,其轉機等待時間超過四小時 □ 本國籍航空公司班機無法銜接轉運。 □ 其他特殊情況。 (説明:) 請依實際狀況,勾選上方選項,	□出國、返國或朝	專機當日,本國	籍航空公司	月班機客位 巳	售滿。
□本國籍航空公司班機無法銜接轉運。 □ 其他特殊情況。 (說明:) 請依實際狀況,勾選上方選項,	■出國、返國或	專機當日,無本	國籍航空公	公司班機飛航	ī°.
□ 其他特殊情況。 (說明:) 請依實際狀況,勾選上方選項,	□ 搭本國籍航空	公司班機再轉機	,,其轉機等	存時間超過	四小時。
(說明:) 請依實際狀況,勾選上方選項,	□本國籍航空公	月班機無法銜接	轉運。		
請依實際狀況,勾選上方選項,	□ 其他特殊情况	0			-
	(說明:) .			
	請	 依實際狀況,勾	選上方選項	į,	
•	若	選其他特殊情況	,則需說明	•	
請簽章,勿用打字。			1	青簽章,勿用	打字。
			_ _		
申請人 職稱 教授 姓名	請人 職稱	教授	姓名	•	
				·	
單位主管 機關首長					

(五)航空公司或旅行社出具票價證明文件。

(非最直接航程(繞道)或非屬得搭乘商務艙人員而搭乘非標準經濟艙者檢附)

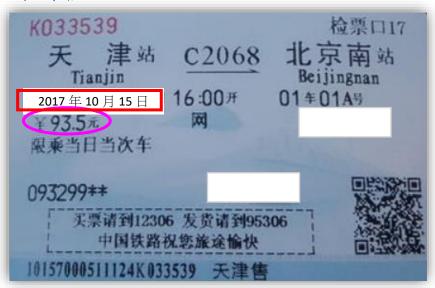


♣ 旅行社出具票價證明文件

从17年间共示员证为 又厅
旅行社 有限公司
FLYING TRAVEL SERVICE CO., LTD 高雄TEL(07)3231288 FAX(07)3232166 台南TEL(06)2653536 FAX(06)2654589
機票報價單
先生您好:
日目前經濟艙已經客滿了,目前只能為您報
日
商務艙 日有位子售價 元合稅金,如需訂位請儘快通知。
謝謝!
在

【交通費】搭乘船舶及長途大眾陸運工具部分

- (一)原始單據或旅行業代收轉付收據。(擇一)
 - ▲ 鐵路票根



【臺幣報支金額】: 93.5*4.498=421

【交通費】搭乘船舶及長途大眾陸運工具部分

➡ 出國前一工作天臺灣銀行賣出即期美元參考匯率表



歷史匯率收盤價

□掛牌時間 2017/10/12 16:00 ← 出國前一工作天。

	現金	涯率	即期匯率		
幣別	本行買入	本行賣出	本行買入	本行賣出	
■ 美金 (USD)	30.49	31.032	30.79	30.89	
■ 港幣 (HKD)	3.819	4.014	3.939	3.999	
英鎊 (GBP)	36.64	38.57	37.51	37.93	
遭 澳幣 (AUD)	23.07	23.73	23.26	23.49	
▶ 加拿大幣 (CAD)	22.53	23.27	22.8	23.02	
新加坡幣 (SGD)	. 21.33	22.11	21.75	21.93	
➡ 瑞士法郎 (CHF)	29.93	30.99	30.46	30.75	
● 日園 (JPY)	0.2605	0.2715	0.2669	0.2709	
■ 南非幣 (ZAR)	-	-	2.3	2.38	
■ 瑞典幣 (SEK)	3.06	3.57	3.4	3.5	
※ 組元 (NZD)	21.05	21.68	21.29	21,49	
■ 泰幣 (THB)	0.7716	0.9146	0.8601	0.9001	
≥ 菲國比索 (PHP)	0.5635	0.6965		- '	
■ 印尼幣 (IDR)	0.00198	0.00268	2200	3 7	
● 歐元 (EUR)	32.11	33.26	32.61	33.01	
. ● 韓元 (KRW)	0.02525	0.02915		-	
★ 越南盾 (VND)	0.00098	0.00148		-	
■ 馬來幣 (MYR)	5.882	7.417	-	-	
■ 人民幣 (CNY)	4.376	4.538	4.448	4.498	

【交通費】辦公處所往返國際機場部分

■ 國立中央大學因公務搭乘計程車請示單。(因公務搭乘計程者檢附,且應事前奉准)

國	立中央大學因公務搭乘計程車請示單
	填表日期:
單位	
搭乘人員	
搭程日期 及時間	
搭乘起訖 點	自 中央大學 至 機場 自 桃園機場 至 中央大學
業務需要 之事由	因隨行行李含雙方討論資料及展示海報、屬公務性質。
單位主管 養 章 申請人簽章	校長 (或其 授權人) 此示
業務 2. 搭乘 3. 公出 因出	國內出並於獎報表更點,第五點賴定;日公民祭內車到達她區,於因 需要,經機關核准者外,其搭乘計程車之費用,不得報支。 計程車業務需要事由之認可,由各單位一級主管決行。 或出差原則上應搭乘大眾運輸交通工具,搭乘計程車為例外;如多人 差事由及地點相同,應以共乘方式搭乘。 計程車之費用應檢據併同國內出差旅費報告表辦理經費核銷。

【交通費】辦公處所往返國際機場部分

(一)收據或票根或購票證明文件或其他足資證明支付票款之文件。(擇一)

▲ 計程車乘車證明或收據

※如有搭乘事 實,應先查填國 立中央大學因公 務搭乘計程車請 示單。

幾場一中大

計程車乘車證明

機場026

駕駛姓名:養良易 行動電話:0922616022 申訴電話:03-3834499

序號(No.): 00005114 車號(Plate): 026-8C

聯絡電話(Tel.): 03-3931789

上車(Start): 2017-10-18 07:10 下車(End): 2017-10-18 07:29

車資(Total,\$):

610

費率版本(Fare Ver.): 机圆市 102-

11

里程(Dist., km);22.9

停等時間(Wait, h:m:s): 00:00:33

斯表金額(Fare, \$): 610

含懶場停留服務費 計豐表職牌(Meter): 玉山

計費表器號(Meter S/N): 00007873

計程

Uber

Thanks for riding, Shantanu

We hope you enjoyed your ride this evening.



相

Total

NT\$748.00

Trip Fare

NT\$748.00

Subtotal

NT\$748.00

Amount Charged

visa ···· 6749 Switch

NT\$748.00

A temporary hold of NT\$748.00 was placed on your payment method *** 6749 at the start of the trip.

This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. Learn More

Rental company: Q TAXI 車隊 - 客服幕線: 0971-619-677

Visit the trip page for more information, including involces (where available)

收據爲網路列印 無實體收據

【生活費】

(一)試算表(連結)

出國前一三天臺銀賣品期美元匯至	出即	30.89						
日期(國外)		106/10/13	106/10/14	106/10/15	106/10/16	106/10/17	106/10/18	總計
搭乘交通工具 時間(國外)		18:45~21:50		16:00~17:00	18:00~19:00		14:45~17:45	/
起訖地點		臺灣→天津	天津	天津→北京	北京→天津	天津	天津→臺灣	
日期(本國)	106/10/13	106/10/14	106/10/15	106/10/16	106/10/17	106/10/18	
搭乘交通 時間(本國		18:45~21:50		16:00~17:00	18:00~19:00		14:45~17:45	
留宿地		天津	天津	北京	天津	天津	K	
日支數額(182	182	251	182	182	182	
應扣除項	:							
供宿	70%						✓	
供膳	20%						-	
早餐	4%							
午餐	8%	✓	✓	✓	✓	✓		
晚餐	8%	0.84	0.00	1.00	0.00	167	50 M	
小計	~ 	8%	8%	16%	8%	16%	70%	20.425
可報支生活	古費	5,172	5,172	6,513	5,172	4,722	1,687	28,438

日期、時間應以<mark>本國</mark>日期、時間計算。

同一日跨越兩地以上, 應以<u>留宿地區</u>之日支數 額報支。

日支數額表未列舉之地 區,應以「<u>其他</u>」報支。

返程或在飛機上等過 夜,扣除當日生活費70 %。

主辦單位供膳宿扣除當 日生活費 90%,供宿扣除 70%,供膳扣 20%(未達三 餐,早、中、晚餐依 4%、 8%、8%計算)。

【生活費】

(二) 出差人員生活費日支數額表。

- ◆ 中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表(連結)
- 単 中央政府各機關派赴大陸地區、香港及澳門出差人員生活費日支數額表(連結)
- ➡ 中央各機關(含事業機構)派赴國外進修、研究、實習人員補助項目及數額表(連結)

中央政府各機關派赴大陸地區、香港及澳門出差人員生活費日支數額表

單位:美元

		単位:美元
編號	名稱(城市或其他)	日支數額
1	北京(Beijing)	251
2	南京(Nanjing)	185
3 <	天津(Tianjin)	182
4	上海(Shanghai)	267
5	瀋陽(Shenyang)	175
6	哈爾濱(Harbin)	166
7	大連(Dalian)	175
8	長春(Changchun)	155
9	濟南(Jinan)	162
10	青島(Quingdao)	176
11	武漢(Wu Han)	170
12	長沙(Changsha)	162
13	西安(Xian)	150
14	成都(Chengdu)	179
15	重慶(Chongqing)	182
16	貴陽(Guiyang)	162
17	鄭州(Zhengzhou)	162
18	深圳(Shenzhen)	180

【生活費】

(三)出國前一工作天臺灣銀行賣出即期美元參考匯率表。(臺銀歷史匯率網站連結) (若無賣出即期匯率者,以現金匯率為依據)



歷史匯率收盤價

□掛牌時間: 2017/10/12 16:00 ← 出國前一工作天。

	現金[選率	即期匯率		
幣別	本行買入	本行賣出	本行買入	本行賣出	
■ 美金 (USD)	30.49	31.032	30.79	30.89	
■ 港幣 (HKD)	3.819	4.014	3.939	3.999	
● 英鎊 (GBP)	36.64	38.57	37.51	37.93	
建 澳幣 (AUD)	23.07	23.73	23.26	23.49	
▶ 加拿大幣 (CAD)	22.53	23.27	22.8	23.02	
新加坡幣 (SGD)	. 21.33	22.11	21.75	21.93	
➡ 瑞士法郎 (CHF)	29.93	30.99	30.46	30.75	
● 日園 (JPY)	0.2605	0.2715	0.2669	0.2709	
■ 南非幣 (ZAR)	-	-	2.3	2.38	
■ 瑞典幣 (SEK)	3.06	3.57	3.4	3.5	
₩ 紀元 (NZD)	21.05	21.68	21.29	21,49	
■ 泰幣 (THB)	0.7716	0.9146	0.8601	0.9001	
➤ 菲國比索 (PHP)	0.5635	0.6965		-	
■ 印尼幣 (IDR)	0.00198	0.00268	2200	3 7	
■ 歐元 (EUR)	32.11	33.26	32.61	33.01	
. ● 韓元 (KRW)	0.02525	0.02915	-	-	
★ 越南盾 (VND)	0.00098	0.00148		-	
■ 馬來幣 (MYR)	5.882	7.417		-	
■ 人民幣 (CNY)	4.376	4.538	4.448	4,498	

【辦公費】手續費部分,包括<u>護照費、簽證費、黃皮書費、預防針費、</u> 結匯手續費及機場服務費。

(一)原始單據或旅行業代收轉付收據。(擇一)

▲ 簽證費-旅行業代收轉付收據

抬頭開立:國立中 央天學(45002931)	旅汽	業代」	炇 轉	付上	炇 據	
買 受 人: 國立中央大學 統一編號: 45002931	·	中華民國			s	S 6664151 66641515 000850244
地址:中壢市中縣路300號	郷市鎮區	街路	金	巷 額。	弄號	樓 !
簽證申讀: 電子台胞卡7天件	MR1	1,700.00		1,700.00	C0001194	58
			22028	3 1 1	更改代轉請 送回:逾期	
,	·					統一發票專用章
				*	統一發 統一 1402	票專用章 編號 22238
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	* 1	計	icheling)	1.700.00	負責人 電話:2 台北市 復興北路5	:普成利 772-7255 球松山區 17號2樓之1
總計新台幣 仟 萬 **	佰 拾 **	萬壹仟柒		** 元整		
本收據依財政部82年3月27日 本收據為旅行同業公會統一印					經手人:	非跨接

♣ 簽證費收據



【辦公費】保險費部分

(一)保險費收據。



Union Insulation Co., Ltd.

旺旺友联邦

民國

新旅行綜合保險(海外型)保險費收據(正本)

赶旺友聯產物保险股份有限公司 本「保費、利息、造價数、手頭費 及其他依法辦理事項之收入等」 收據印花親總縣 台北市 負責總缴人:洪吉雄

> 統一編號: 03110001

保險單號碼: 1200~08NTA0000981

亞保人:

被保险人: 王大明

◆ 被保險人:出差人(王大明)

新台幣肆佰伍拾捌元整 保险費:

NT\$458

保险期間: 自民國 106年10月13日

09時 起至民國

106年10月18日

归辟 止

投保期間:應與出差時間相符。

支票付款:為保障您的權益,請關本公司抬頭察背即期支票。 本收據未具備本公司總經理及收費員章無效



總 總值量話



(二)共約保險公司因公赴國外出差或返國述職人員綜合保險費率表。(非利用共約保險公司者檢附)

		保障內	容:	【一般	t方案】	15足)	炎(含)以	上		保放金額	頭: 400	萬元
天數	保管	天數	保費	天數	保貨	天數	保費	天教	保費	天數	保費	天敦
1_	104	41	390	81	671	121	944	161	1, 224	201	1, 505	241
2	110	42	398	82	678	122	951	162	1,232	202	1,511	242
3	119	43	405 _	_83_	684	123	957	163	1, 238	203	1.518	243_
4	125	44	411	84	690	124	965	164	1, 245	204	1.524	244
5	133	45	419	85	697	125	972	165	1,253	205	1,530	245_
6	140	46	426	86	703	126	980	166	1,259	206	1,537	246
7	148	47	433	87	709	127	986	167	1, 268_	207	1,543	247
8	154	48	440	88	715	128	995	168	1, 274	208	1,549	248_
9	163	49	_448	89	723	129	1,000	169	1, 282	209	1,558_	249
10	169	50	454	90	729	130	1,009	170	1,288	210	1,563_	250
11	175	.5.1	463	91	736	131	1.015	171	1, 296	211	1,569	251
12	183	. 52	469	92	742	132	1,023	172	1, 303	212	1, 572	252
13	190	53	475	93	748	133	1.030	173	1,309	213	1, 578	253
. 14	198	54	482	94	757	134	_1.036	174	1,315	214	1,580	254
15	204	55	488	95	763	135	1.044	175	1.322	215	1,586	255
16	213	56_	494	96	771	136	1,051	176	1, 328	216	1,588	256
17	219	57	501	97	778	137	1, 059	177	1, 334	217	1, 595	257
18	227	58	507	98	786	138	1,065	178	1.341	218	1, 597	258
19	233	59	513	99	792	139	1.074	179_	1.347	219	1.603	259
20_	242	60	521	100	801	140	1.080	180	1,355	220	1.605	260
_21	248	61	527	101	806	141	1.089	1.81	1, 362	221	1,611	261
_22	254	62	533	102	815	142	1.094	182	1.368	222	1.614	262
23	263	63	540	103	821	143	1,100	183	1,374	223	1.620	263
24	269	64	548	104	827	144	1,107	184	1,382	224	1,622	264
25	277	65	554	105	836	145	1,113	185	1, 388	225	1,628	265
26	283	66	563	106	842	146	1,119	186	1,397	226	1,630	266
27	292	67	569	107	851	147	1, 126	187	1,403	227	1,637	267
28	298	68	578	108	857	148	1, 132	188	1,411	228	1,639	268
29	306	69	584	109	865	149_	1, 140	189	1,418	229	1,641	269
30	313	70	592	110	872	150	1,146	190	1,426_	230	1, 643	270
31	319	71	599	111	880	151	1, 153	191	1, 432	231	1,649	271
32	326	72	607	112	886	152	1, 159	192	1,441	232	1,651	272
33_	332	73	613	113	893	153	1,166	193	1,447	233	1,653	273
34	340	74	619	114	899	154	1,174	194	1,453	234	1,656	274
35	346	75	627	115	904	155	1,180	195	1, 462	235	1.658	275
36	354	76	634	116	911	156	1, 188	196	1,468	236	1,659	276
37	361	77	642	117	917	157	1, 194	197	1, 476	237	1,661	277
<u> 38</u>	369	78	648	118	923	158	1, 203	198	1.482	238	1,663	278
39	375	79	657	119	930	159	1,209	199	1,490	239	1,665	279
-40	384_	80_	663_	120	938	160	<u>l_1,217</u>	200_	1,497	240	1,667	<u> 1 280</u>

- ▶ 保險金額以 400 萬元為上限。
- ▶ 擬不利用共同供應契約訂購者,請加填國立中央大學「環保產品」、「不利用共同供應契約」理由書,並以『共約保險公司因公赴國外出差或返國述職人員綜合保險費率表』保費為報支上限。

【辨公費】保險費部分

(三)國立中央大學「環保產品」、「不利用共同供應契約」理由書。

(非利用共約保險公司者檢附)

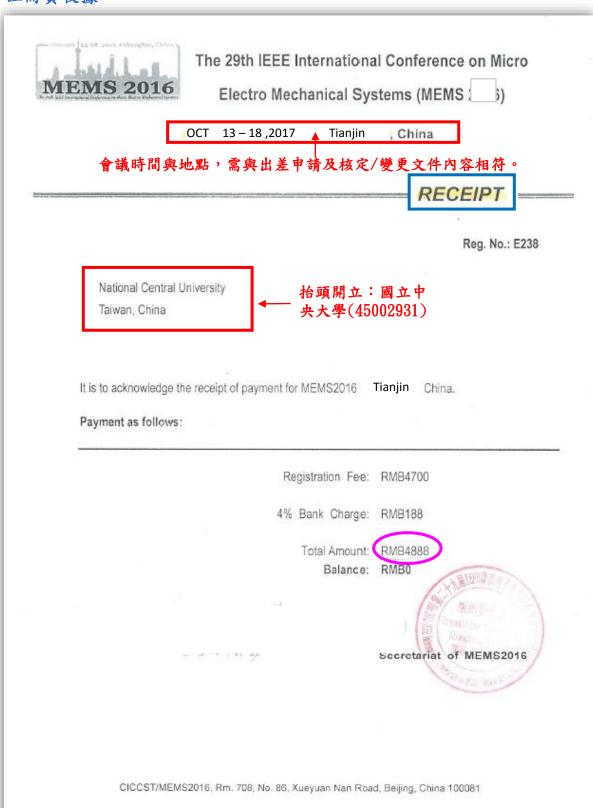
國立中央大學「環保產品」、「不利用共同供應契約」理由書

_						
	標的名稱	出國差旅意外保險	數量(單位)	1次	
殿牌/型號		因公赴國外出差綜合保險	費 金額	(元)	新台幣:實支	元
	規格摘要	一般方案				
	標章號碼	屬前頁 C 情況適用。 請填入環保標章號碼: 查詢網站:「綠色生活資訊網	 月」→「產品查詢	٦ ٦		
	保 產 品 不統計理由	屬前頁 D 情況適用。內容: 1.於 年 月 日綠色生活品。(請檢附畫面為佐證) 2.無法採購環保標章產品之。 3.擬請同意採購無環保標章	原因或規格描述	:		保標章產
	不利用共約理由	屬前頁 C、D、F情況適用。 □共約產品不符合所需要之規明): □自行採購價格明顯較便宜(列 □共約目前空窗期間需緊急採) □訂購不及契約規定基本量 本校酌收運費。若選擇不利用共經 ■其他:因保險內容有異,故自	印共约平台對照項 購(列印共約平台該 (組、個)或 分者請先查明共约產	目及價格] 類產品檢 金額	頁面) 索頁面) 元(不及基本量者,	大實際狀
	請購單位		請購人			
	聯絡電話	03-4227151 #	主管核章			
	填寫日期	中華民國 年 月 日				

【辦公費】行政費部分,包括<u>在國外執行公務所必要之資料、報名、註</u>冊、郵電、翻譯及運費等費用。

(一)原始單據或旅行業代收轉付收據。(擇一)

▲ 註册費收據



【辦公費】行政費部分,包括在國外執行公務所必要之資料、報名、註冊、郵電、翻譯及運費等費用。

- (二)信用卡帳單<u>或</u>出國前一工作天臺灣銀行賣出即期外幣參考匯率表或銀行結匯 水單。(擇一)
 - ♣ 信用卡帳單

消費明							tion that	
新臺幣								
消費日	入帳 起息日	交易說明	新臺帶金額	卡號 後四碼	行動卡號 後四碼	消費国家	常別	外傳金額
04/09	04/10	上期帳單總額 到局自動扣繳	13,861 -13,861					
		調情	-13,861					
03/21	03/26	eTag 储值金_AYC-1218	400	737x		TW	TWD	
03/22	03/25	好市多中是加油站	1,055	73 fy		TW	TWD	
03/22	03/25	好市多中湿店	59	73/x		TW	TWD	
03/22	03/25	好市多中堰店	9,262	73 / /		TW	TWD	
03/24	03/25	好市多中医加油性	1 044	75 √ ×		TW	משנו	
03/30	04/22	國外交易手續費 -PAYPAL	238	734%				
03/30	04/02	PAYPAL* MEMS	25, 440	3××		··ÜS	RMB	4, 888

外幣金額要與註 冊費收據相符。

- ▶ 1. 以信用卡支付者,需檢附其對帳單,以其換算成台幣之金額報支。
- ▶ 2. 不以信用卡支付者,以出國前一工作天臺灣銀行賣出即期匯率換算報支。

【辦公費】禮品交際及雜費部分,包括禮品費、交際費、計程車費、租車費等。

(一)原始單據或旅行業代收轉付收據。(擇一)

▲ 禮品費發票



按出差日數每人每日600元總額度內檢據覈實報支。

本案出差6日,可報支上限為3,600元,但檢附發票金額僅為2,592元,故禮品交際及雜費僅能報支2,592元。

【附件:產學合作計畫】

【計畫資料文件】

(一)國立中央大學計畫人員名冊(甲式)或(乙式)。(依出差人員適用類別擇一)

		āt:	畫主持人:		
十畫名稱:		計	畫執行單位:		
畫執行期間 :	◆ 出差期	間應在計畫執	行起訖日	內。	
身分類別	單位/系所	職稱	姓名	聘任期間	審核透過日 期/時間
博士後研究人員					
產學合作及推廣教育計畫 人員	Ī				
產學合作及推廣教育計畫 人員	1				
產學合作及推廣教育計畫 人員					
產學合作及推廣教育計畫				憲為計畫內 應在計畫聘	
人員 ·			•	ļ	
人見 產學合作及推廣教育計畫 人員					

【核定文件】

(一)委辦單位核定經費編列預算表。

貳、預算經費編列

/ 1X 3L %	空質を開かり				
	108 年	吉	畫 標	價清單	
計畫內容	項目	單價	數量	單位	金額
		ŀ			,000
),000
					,000
樹 星					,000
),000 1,000
					3,000
),000
					2,000
					3,000
),000
^前 场					5,000),000
					2,000
	410			1	
海外國際展 覺活動	國際展覽活動(含報名費、 展位費、機票、住宿、保險 及手續費)	300,000	5	組	1,500,000
	成果分享會	30,000	1	場	30,000
	小計				1,530,000
	小 / 秦 〈二 / 上	200.000	,	بد	307,000
),000
雜					3,000
					3,000
	शक्ष व				J,2v0,000

【附件:科技部專題研究計畫】

【計畫資料文件】

(一)國立中央大學經費分配表。

		國立口	中央大學	學經費	分配表		
版次		6		400	費流水號		
計量主持人 /聯絡資訊				製表	人(送審人) 詳絡資訊		
計畫類別		科技部專題	研究計畫	計畫	執行單位		-
結案時原始憑證繳回		否		結案限	结素時結餘款繳回 全部總		全部繳回
科技部計畫編號						-	
計畫名稱		價創計畫:食物	物過敏原檢驗物	聯網系統			
委託單位		科技	部	適用	科研採購法		是
執行起迄日		出,	差期間應在	計畫執行	行起訖日內。		
			經費	項目			
經費用途	原/	變更後核定金額	累計流	出金額	累計流入金額		實際可用金額
樂務費		17,980,931	()	258,223		18,239,154
彈性支用		0)	0		0
P人事費		456,000	()	0		456,000
管理費		1,813,069	(0			1,813,069
國外差旅費		750,000	258,	223	0		491,777
總計		21,000,000	258,	223	258,223		21,000,000
			申請單領	養核歷程			
簽核點名稱	簽核	者	簽核時間		結果		簽核意見
權責單位一級	1				通過		
權實單位二級	(工具/1) 型		應有「國」項目。		通過		
権賈單位承辦人		7	J 'N ₩		通過		
執行單位一級					通過		
執行單位二級					通過		
[填表人]		, ,					

【計畫資料文件】

(二)國立中央大學計畫人員名冊(甲式)或(乙式)。(依出差人員適用類別擇一)

	國立中央大學	學計畫人員名冊	册(乙式)		
計畫流水號: 計畫名稱:			畫主持人: 畫執行單位:		
計畫執行期間:	◆ 出差期	間應在計畫 载	九行起訖日	1內。	
身分類別	單位/糸所	職稱	姓名	聘任期間	審核通過日 期/時間
博士後研究人員					
產學合作及推廣教育計畫 人員				應為計畫內 應在計畫聘	
產學合作及推廣教育計畫 人員				↓ ↓	<i></i>
產學合作及推廣教育計畫 人員	生醫科學與工程學系	専任人員	王大明	1060101- 1061231	2015-02-26 08:33:02
適用: 非支薪人員、專案教研	人員、統一造冊専任助理	、博士後研究、特別			D-05-08 14:50:45 人員等・

【核定文件】

(一) 科技部經費核定清單。

▲ 科技部經費核定清單

	,		第 222 次 報	与 7-3	108/04/03	(第 222 次通過)
108年度	r			】經到	貴核定清單	
執行機構:國立中	中央大學	Ė	持 人:			
補助項目	申請金額	核定金額		兌	明	
業務費	18,436,931	18,436,931	一、研究人力、耗材、 1.主持人研究費1名 ※計畫主持人得依報 內容、專業技能、 相關費用。 二、本計畫彈性支用額	,月支25 行機構自 預期績效	,000元(12.000月 訂標準考量實際 次表現等因素,方	目 目計) 祭約用研究人力之工作 於補助經費內調整核給
國外差旅費	750,000	750,000	一、國外差旅費: 750 1.参訪差旅費: 750 二、本項目不核列管理	000 7 7:		差旅項目,核 單應有核定。
管理費	1,813,069	1,813,069				
合 計	21,000,000	21,000,000	執行期限: 計畫編號:	出差期	間應在計畫	執行起訖日內。
研究性質:應用和	十畫/科技計畫(個 开究 报告 國立中央大學 青依「科技部補助		學門名稱 結計畫作業要點」規定	: 新型態: 計畫 :辦理。	董學研 鏈 結 流	水號: 108T0D0143802 承辦人: 高鴻文

【核定文件】

- (二) 科技部計畫申請書(國外差旅費部分)或國立中央大學國外差旅費變更項目申 請對照表。(擇一)
 - ▲ 科技部計書申請書

// 國外差旅費~出席國際學術會議:

- (一)計畫主持人及參與研究計畫之相關人員參加國際學術會議得申請本項經費。
- (二) 請詳述預定參加國際學術會議之性質、預估經費、天數及地點。
- (三)機票費、生活費及其他費用之標準,請依照行政院頒布之「國外出差旅費報支要點」規定填列 (網址https://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017584)。
- (四)請詳述計畫主持人近三年参加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形。(包括會議名稱、時間、地點、發表之論文題目、補助機構,及後續收錄於期刊或專書之名稱、卷號、頁數、出版日期)

(五)請分年列述。 金額單位:新臺幣元 出席國際學術會議 127, 292博士生人数 共 0 名 金 額 页定参加國際學術研討會 费用规明 計畫書內容,需與出差申請 及結報內容相符。 近三年論文發表情形

變更後內容,需與出差申請及結報內容相符。

 ■ 國立中央大學國外差旅費變更項目申請對照表。(舊版紙本表單)

執行單	位		計畫主		計畫流水號	
計畫編號 計畫名稱				核准文號		
			之研究		<u> </u>	
合约期	限					牧文章
九行年度	原核補助出國項目		8定項目 金額(A) 補助出國項目		擬變更項目(B應≤A)	
					變更支出用途	金額(B)
	國外差	旅費	50000	國外差旅費	國際會議變更	50000
逆更理由 记 明						
2 明	<u>際</u> 地	會議並發3 點、人數 說明欄內:	表論文、國際合作, 、人員(請詳列其女 半述變更理由。	計畫所寫,變更補 研究計畫)、經費流 生名)、或國際會議勢	用、支出用途(包含 更更),請依規定於	: 出國天數、次數、 事前提出申請,並
社	整 <u> </u>	會議並發表 點、人數 說明欄內 1 完 關際學 3 議 主 持 人 類 更 金 額 5 3 6 3 6 3 5 6 5 6 7 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	表論文、國際合作、 人員(請詳列其女 并述變更理由。 新會議並需發表論 者,請附邀請函。 以不超遇原核定國	研究計畫)、經費流月 注名)、或國際會議等 文成果,請附論文 外差旅費總額為原見	用、支出用途(包含 更更),請依規定於 被接受函。若為專 則,逾該金額者,	: 出國天數、次數、 事前提出申請,並 題演講或受邀擔任 請依規定辦理流用
社	2. 出會擬申 3. 申 4. 政	會議並發發 就明欄內 說明欄內 就	表論文、國際合作、 人員(請詳列其女 并述變更理由。 新會議並需發表論 者,請附邀請函。 以不超遇原核定國 申請表請附核定済 長,由計畫主持人	研究計畫)、經費流月 生名)、或國際會議場 文成果,請附論文表	用、支出用途(包含 更更),請依規定於 被接受函。若為專 則,逾該金額者, 會計畫書國外差旅	: 出國天數、次數、 事前提出申請,並 題演講或受邀擔任 請依規定辦理流用 費項目; 本表經行

【核定文件】

単 國立中央大學國外差旅費變更項目申請對照表。(新版電子表單)1/2

▲、計學及經濟等	ア理温 » 計畫及經費變更 »		
们 # 时起2000 元 元 元	经担心的重次起来是更加	@ ±±=	及經費變更 -
		一	及殺實變史 -
	經費/用途變更 (經費總額不變)	
(-)	版次:6 計畫歸屬:個人 經費流水號:		
	計畫結案時須繳回結餘款:全部繳回 計畫結案時須繳回原始憑證;否 科技部編號:		
(=)	計畫名稱: 計畫類別: MOST-01 科技部專題研究計 本校計畫執行期間: 奉准延長期限:	畫	
(≡)	執行單位: 委託單位:科技部		,
(四)	主持人單位: 主持人姓名: 主持人Email 主持人分機: 執行本計畫身 彈性支用額度: 25,000		
(五)	業務費 彈性支用 P人事費 管理費 國外差旅費	核定金額 17,980,931元 0元 456,000元 1,813,069元 750,000元	流用後金額 18,239,154元 0元 456,000元 1,813,069元 491,777元
	經費總額	21,000,000元	21,000,000元
核准文號 送審人		-	
*送審人聯絡資			Mineral Surf Surfamente commune surfa Surviva - 1 mm 1 m
			Minator acceptable when the control of the control
變更原因	變更用途說明/備註(經費不變)		11 2000
變更說明	國外差旅費變更	ANY REAL PROPERTY OF THE PROPE	TO STATE OF STREET STREET STREET STREET
上傳變更相關證	9		
明文件			description of the second seco
公文文號			
	變更用越	慰朗/備註 +	

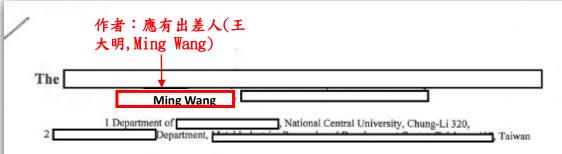
【核定文件】

単 國立中央大學國外差旅費變更項目申請對照表。(新版電子表單)2/2

欲變更用途說 明之項目	國外差旅費-出席國際馬	2術會議		Windowski wa wa sana wa
變更前用途說 明	一、國外差旅費:750,0	000元:參訪差旅費:750,000	 ○元二、本項目不材	亥列管理費
變更後用途說 明 變更後內容	科技部出席國際會議變 更 +	本次欲。新增 取消 · 會議图 · 會議時間	國家/地點 ゲ参加會	養人貝
變更後內容,需與出差申請及結報內容相符		を加 ・並 ® 發表研究成果論文		
報內容相符。			EL SPESSON IN L	自成工17八
		申請單簽核歷程		
計畫權實單位	A670研發處計畫管理	型組 二	代電子表單獨號	37036
簽核點名稱	養核	者	簽核時間	結果 簽核意見
權實單位一級主管				通過
主計室主任				通過
主計室組長				通過
主計承辦人				通過
權實單位一級				通過

(一)論文被接受或受邀專題演講或擔任會議主持人之證明文件。(擇一)

▲ 發表論文摘要



Abstract

A deep hole drilling on silicon substrates are difficult nowadays, not only because of the use of toxic solutions, but also because of the efficiency of machining. In various non-traditional machining techniques, electrochemical machining (ECM) has many merits, such as high machining rate, no surface residual stress, and low surface roughness, and has been considered as one of the highly potential machining method.

In this paper tungsten carbide rods with diameters of 50 and 100 µm are used as cathodes (tools), and p-type single crystal silicon-based wafers are used as anodes (work-pieces) to undergo the electrochemical machining. Four kinds of electrolytes, namely ammonium fluoride, hydrofluoric acid, ammonium fluoride plus hydrochloric acid, and ammonium fluoride plus sulfuric acid, are used to investigate their effects on the drilling diameter and depth. Experiments show that ammonium fluoride and ammonium fluoride plus hydrochloric acid result in poor electrochemical machining. Ammonium fluoride plus sulfuric acid yields better machining than conventional hydrofluoric acid. The diameter of drilled hole can reach 108.7 µm as a tool of diameter 50µm is used to drill a 100µm depth hole on silicon-based wafers.

Keywords: Electrochemical Machining, p-type silicon-based wafer, ammonium fluoride

1. Introduction

Silicon is an important semiconductor material due to its unique electronic properties, such as: low thermal expansion coefficient, high thermal conductivity. Its mechanical properties, including hardness, elasticity coefficient, torque coefficient and compressive strength, are slightly influenced by the lattice direction. Compared to other semiconductors, silicon devices have better characteristics at room temperature and high quality silicon oxide layers can be produced inexpensively. Silicon has therefore been the main material used in semiconductor manufacturing since 1960s.

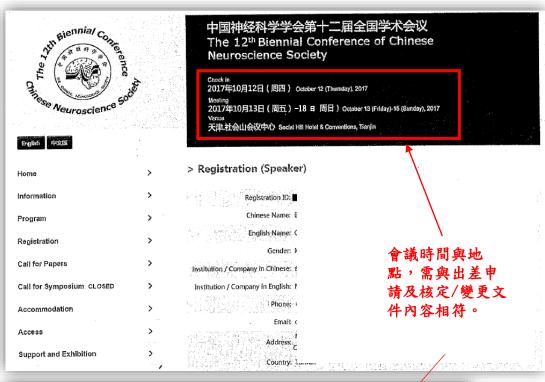
Semiconductor machining is mainly used to transfer electrical circuit patterns onto wafers. The two major methods of pattern transfer are lithography and etching. Lithography requires costly optical systems such as clean rooms, exposure machines, masks and photo-resists, and is unsuitable for small manufacturing firms. The two conventional etching processes are wet-chemical etching and dry etching. Wet-chemical etching is widely used in semiconductor manufacturing, especially for comprehensive etching. However, this method achieves limited resolution. Dry etching, however, provides highly accurate pattern transfer. The most difficult areas to etch are the convex and concave corners where the intersection of two or more {111} planes generates complex and poorly controllable phenomena. This so-called "corner compensation" is a continuing problem despite years of experience.

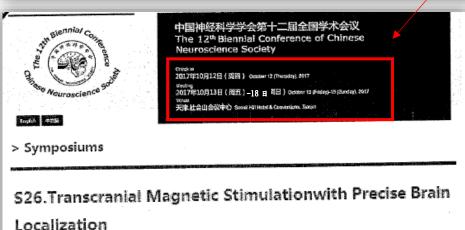
Electrochemical machining (ECM) is a potential alternative process for fabricating semiconductors. The advantage of this non-conventional machining technique is its simple fabrication process, inexpensive equipment, and its low cost. The underlying principle of ECM is the electrolysis phenomenon demonstrated by Michael Faraday in 1833. A voltage applied between two electrodes immersed in electrolyte removes the anode material by electrolysis dissolution. Eventually, the desired anode shape is obtained. Since electrochemical reactions occurs during the ECM process in order to machine the workpiece, therefore any electric conductor can be machined regardless of their own material properties and there is no residual thermal stress in final products. The anode (tool) releases electrons and dissolves cations out during electrochemical reactions. These cations and hydrogen bubbles generated by the cathode (workpiece) would be away from the gap between two electrodes. Under the continuous electrochemical reactions, the tool is moved toward the workpiece with a constant feeding rate. Eventually, shapes inverse to that of the tool are obtained. Since ECM is a non-contact process, no tool wear or burr occurs during the machining process, which makes it suitable for mass production.

Zhang [1] studied the anode polishing process of silicon in hydrofluoric acid solution. From the typical I-V plots scanned, the electrochemical reactions can be divided into three regions, namely etching region of porous silicon, over-mixed region, and electrochemical polishing region according to the level of applied voltage. If the concentration

附件門納持令英表之論文

受邀專題演講相關證明文件。





Organizer : Ming Wang

Time: 15:00~18:00; Saturady, Oct.14

Speakers:

Yufeng Zang, Hangzhou Normal University

Ze Wang, Temple University, USA

Jijun Wang, Shanghai Jiao Tong University

Chunlei Shan , Shanghai University of Traditional Chinese

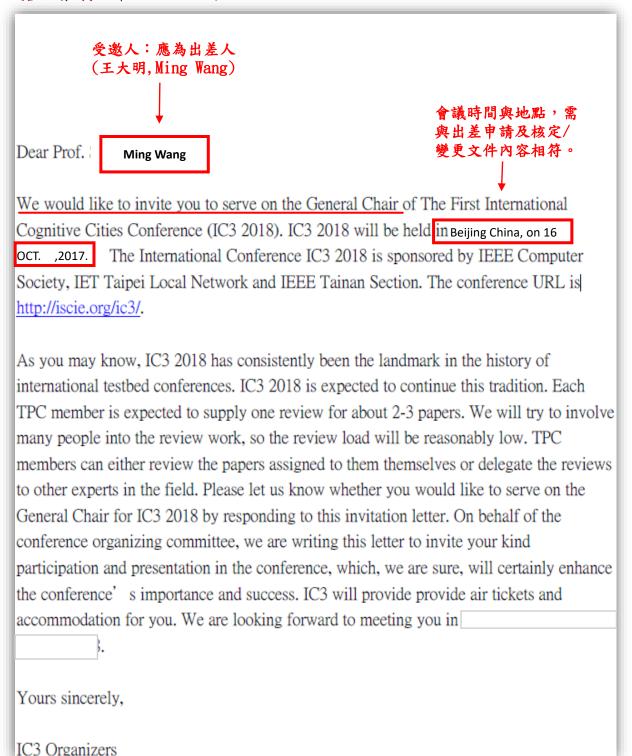
Medicine

, National Central University Ming Wang

Xuchu Weng, South China Normal University

演講人:應為出差人 (王大明, Ming Wang)

▲ 擔任會議主席之證明文件。



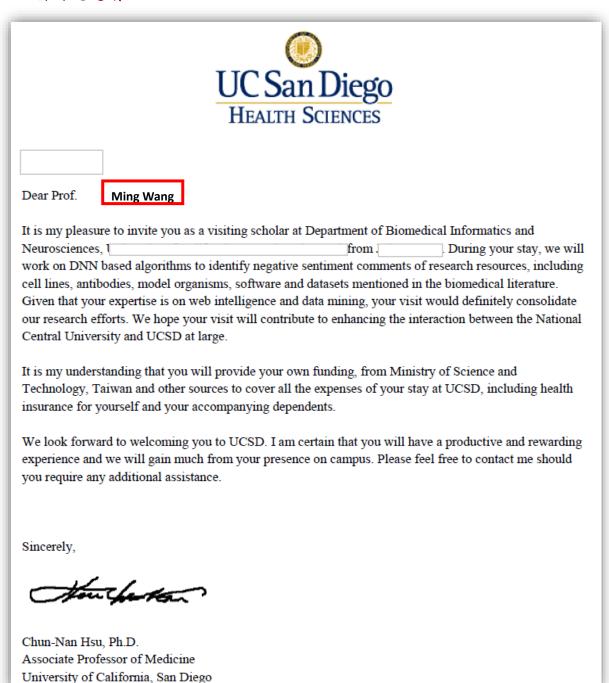
(二) 會議議程。

	Ĺ
Mechanical Engineering (2)	7
Session Chair: Prof. Ming Wang	
GCEAS-523	5
The Effects of Magnetic Field on the Hydrogen Production by Multi-Electrode	
Water Electrolysis	
Ming Wang National Central University	
Vational Central University	
Army Academic College	
GCEAS-548	
Relationship between Car Backrest Vibration and Car Interior Floor Sound with	
Condition of Speed Varying	
Boothum Wongchai Kasetsart University	
GCEAS-558	
Adaptive Control Chart for Monitoring the Short-Term Burr XII Process	
Capability	
Mou-Yuan Liao Providence University	
GCEAS-581	
A Study of Energy Performance of Accommodation Building in Kanto Region -	
Japan	
Haitham Alkhalaf Keio University	
Wanglin Yan Keio University	
GCEAS-607	
Numerical Simulation of High Reynolds Number Turbulent Steam Jet	
Taejoon Kim Korea Hydro and Nuclear Power Co., Ltd	

【執行國際合作與移地研究,或出國參訪及考察】

(一) 邀請函或其他證明行程文件。(擇一)

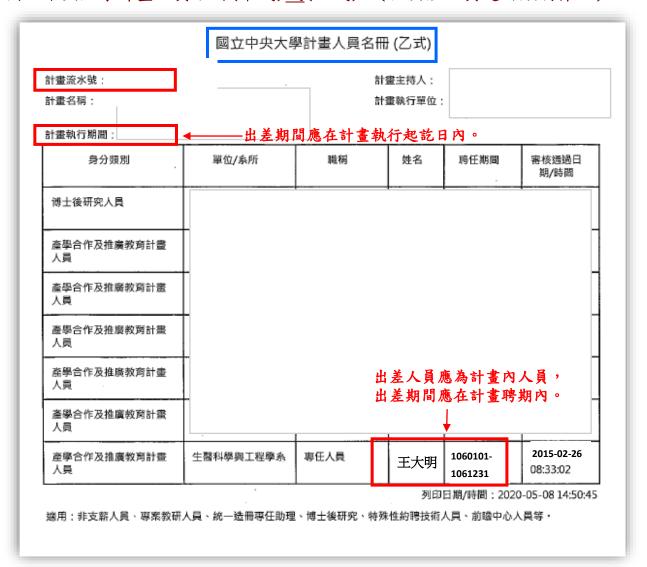
▲ 短期研究邀請函。



【附件:高教深耕計畫】

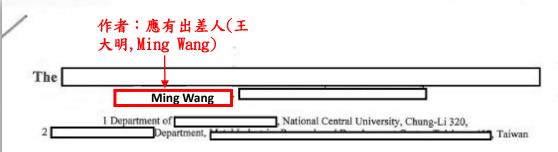
【計畫資料文件】

(一)國立中央大學計畫人員名冊(甲式)或(乙式)。(依出差人員適用類別擇一)



(一) 論文被接受或受邀專題演講或擔任會議主持人之證明文件。(擇一)

▲ 發表論文摘要



Abstract

A deep hole drilling on silicon substrates are difficult nowadays, not only because of the use of toxic solutions, but also because of the efficiency of machining. In various non-traditional machining techniques, electrochemical machining (ECM) has many merits, such as high machining rate, no surface residual stress, and low surface roughness, and has been considered as one of the highly potential machining method.

In this paper tungsten carbide rods with diameters of 50 and 100 µm are used as cathodes (tools), and p-type single crystal silicon-based wafers are used as anodes (work-pieces) to undergo the electrochemical machining. Four kinds of electrolytes, namely ammonium fluoride, hydrofluoric acid, ammonium fluoride plus hydrochloric acid, and ammonium fluoride plus sulfuric acid, are used to investigate their effects on the drilling diameter and depth. Experiments show that ammonium fluoride and ammonium fluoride plus hydrochloric acid result in poor electrochemical machining. Ammonium fluoride plus sulfuric acid yields better machining than conventional hydrofluoric acid. The diameter of drilled hole can reach 108.7 µm as a tool of diameter 50µm is used to drill a 100µm depth hole on silicon-based wafers.

Keywords: Electrochemical Machining, p-type silicon-based wafer, ammonium fluoride

1. Introduction

Silicon is an important semiconductor material due to its unique electronic properties, such as: low thermal expansion coefficient, high thermal conductivity. Its mechanical properties, including hardness, elasticity coefficient, torque coefficient and compressive strength, are slightly influenced by the lattice direction. Compared to other semiconductors, silicon devices have better characteristics at room temperature and high quality silicon oxide layers can be produced inexpensively. Silicon has therefore been the main material used in semiconductor manufacturing since 1960s.

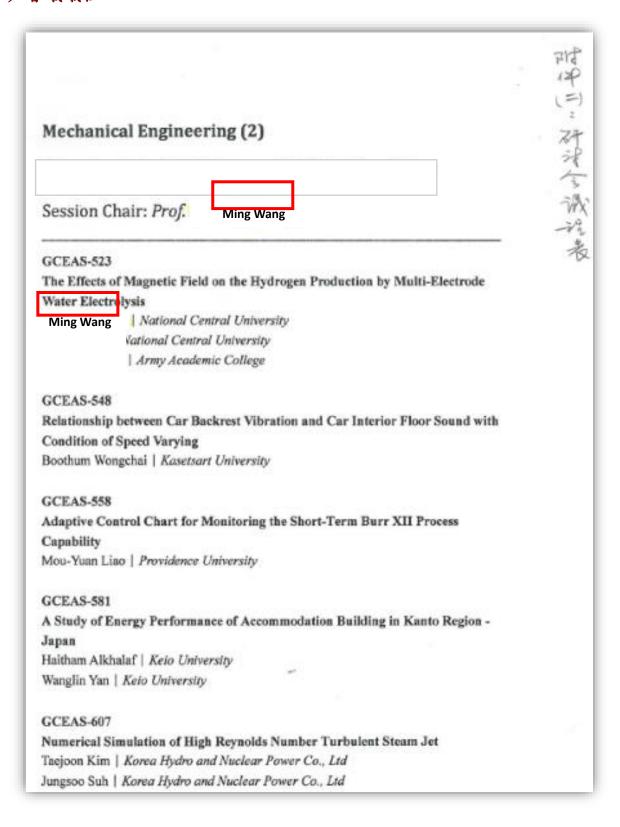
Semiconductor machining is mainly used to transfer electrical circuit patterns onto wafers. The two major methods of pattern transfer are lithography and etching. Lithography requires costly optical systems such as clean rooms, exposure machines, masks and photo-resists, and is unsuitable for small manufacturing firms. The two conventional etching processes are wet-chemical etching and dry etching. Wet-chemical etching is widely used in semiconductor manufacturing, especially for comprehensive etching. However, this method achieves limited resolution. Dry etching, however, provides highly accurate pattern transfer. The most difficult areas to etch are the convex and concave corners where the intersection of two or more {111} planes generates complex and poorly controllable phenomena. This so-called "corner compensation" is a continuing problem despite years of experience.

Electrochemical machining (ECM) is a potential alternative process for fabricating semiconductors. The advantage of this non-conventional machining technique is its simple fabrication process, inexpensive equipment, and its low cost. The underlying principle of ECM is the electrolysis phenomenon demonstrated by Michael Faraday in 1833. A voltage applied between two electrodes immersed in electrolyte removes the anode material by electrolysis dissolution. Eventually, the desired anode shape is obtained. Since electrochemical reactions occurs during the ECM process in order to machine the workpiece, therefore any electric conductor can be machined regardless of their own material properties and there is no residual thermal stress in final products. The anode (tool) releases electrons and dissolves cations out during electrochemical reactions. These cations and hydrogen bubbles generated by the cathode (workpiece) would be away from the gap between two electrodes. Under the continuous electrochemical reactions, the tool is moved toward the workpiece with a constant feeding rate. Eventually, shapes inverse to that of the tool are obtained. Since ECM is a non-contact process, no tool wear or burr occurs during the machining process, which makes it suitable for mass production.

Zhang [1] studied the anode polishing process of silicon in hydrofluoric acid solution. From the typical I-V plots scanned, the electrochemical reactions can be divided into three regions, namely etching region of porous silicon, over-mixed region, and electrochemical polishing region according to the level of applied voltage. If the concentration

附件門研讨令英表之論文

(二) 會議議程。



【附件:專案補助出國計畫】

(一) 補助單位核定函。

			科技	郭 函	1							
			承電傳	址辦話真子 信	700 00 a 000000			****				
32001												
25.76.00.00.00	央大學 中壢區中大路:	300 8	17									
受文	MANUS 1	000 200										
發文日												
發文字												
	普通行	de Huwer I do 15										
谢寺丛 附件:	解密條件或保持	台朔欣、省通										
主旨	: 貴校			擬	於							
	X 1.2								岡	際品	基後	ří
	議,依本	部補助國」	为研究片	北皮	व्या विद्य	學術	企 部	北				
		乙案,核?					10000	CIF	364	X 11	u I	- 1
Dn G4		○未,核/	之作[19]又	9641	, 9)4	豆林	10					
說明		shot h to	* #4		. 24	nL +5	13 11	^	中东	£., -		
		總額為新:	医龟		· 7ff	助項	H A	E	书具:	gu	Γ,	3
	請先行墊					100 - 14-			1.2-01		- N	w.c
	(一)機票費		15776317			最直					12:17	
3500	機往返	經濟艙機	票費・#	後票請	先自	行購	買(若	無.	法才	答本	-1
	班機,	得由本人	真具因么	四出公	人員	搭乘	外區	籍	航	空力	4 5]]
	機申請	書,經任]	職機構言	1長或	授權	代理	人核	定定	後	1 7	可改	1
	國外班	機,如未	附申請	書,有	克照	行政	院之	規	定	, 7	下于	
	銷)。											
	(上)註冊費	0										
	(王)上述機		开带請先	自行	執付							
-	、補助編號		1 21 -11 -1	2 14 14			結報	脐	請	註月	月初	i
100		以利作業		1 0.000000	AECALIDAS.	77.				3275		* 7
Ξ		MONTH ME										
-												
5.09242												
123	,											

【附件:學雜費收入/推廣 教育學分班收入、管理費、 結餘款/產學合作技術收 入、管理費、結餘款/技術 移轉授權金/場地設備管理 收入/受贈收入】

	國立中	央大學出國經	費動支申請單	
出國者	單位		職稱	
E-mail			聯絡電話	
de på skrind	□招生、□考察、□多	F究、□訓練、□進修	、□實習、□實驗	
出國類別	□田野調查、□洽談學	-術合作交流、□出	席國際會議、□其他	
出圈地點	國 家		城市	
出國期間		年 月 日	至年月	В
	會議名稱			
್ರೀರ್ಥೆಯ ಅನ	會議主辦單位			
出席國際 會議	中 3	ζ.		
質 40% (智族・耐免	發表論文題目 英 3	ζ.		
珠)	Ses	sion Chair or Conve	ner \ Keynote Speak	er \ _Invited Spea
→	會議參與性質 □Invi	ted VIP \ _Oral \	Poster \ Other :	
出國目的及 事後申請 説明	(凡出國者應於事前提出申請,並			
	■学雜費收入(○推動		•	(分銀)
	□推廣教育收入(○學□產學合作收入、政府	(流)		
	○技術服務、○管		元之収入	ton dik
經費來源	□技術移轉授權金			經費 流水號
	□場地設備管理收入			加小城
	□受贈收入			
	□其他收入:			
	補助項目	預估經費	説	明
' 經	交通費			
費	生活費			
常	辨公費(如子續費、保险費、			
求	行政费、禮品交際及雜費)			
	Ⅰ 슼 삵		\	

- 三、國人員應檢附下列相關證明文件:1.接洽文件、邀請品、行程表或出調計畫 書。2. 出席國際會議應檢附論文被接受發表證明文件,擬發表之論文稿要、 會議議報。若無前述資料,請附「大會正式邀請函」或其他證明文件,前这 文件未能檢具者,應註明補送,並於會議舉行日一週前送達。3.其他計畫委
- 又件不能推升有, 應之明相之, 並以 5 明十二 托單位或合約書要求之提明文件。 耐、使用校管理費、結餘數出圖者,應檢附核准簽呈;使用單位管理費、結餘款 出圖者,應檢附單位用意使用之會議紀錄。 上面出來和上面接買或被負用使止約分層負責明細表辨理。

本出回經貨助支申請	平登核程序依本投分層負責明	陳收群 集。		
申請人	計畫主持人	單位主管	一級主管	校長或 授權人代為決行
	1	1		

請依實際擬動支經費來源勾選。